

SEM ユーザーズミーティング

プログラム

09: 30～	受付	
10: 00～10: 10	開会挨拶	
10: 10～10: 40	IoTクロスセクションポリッシャ TM の新機能の紹介 ～高速・冷却・非曝露加工で進化する試料作製～	日本電子株式会社 SI事業部門 EP事業ユニット EPアプリケーション部 應本 玉恵
10: 40～11: 10	高自由度・高安全性を備えた FIB-SEM JIB-PS500iの応用例紹介	日本電子株式会社 SI事業部門 EP事業ユニット EPアプリケーション部 中島 雄平
11: 10～11: 45	大学における FIB-SEM装置(JIB-4700F) の活用事例 ～先端研究から共用機器運用まで～	大阪公立大学 戸川 欣彦 様
11: 45～12: 15	昼食	
12: 15～13: 00	実機・ポスター展示	
13: 00～13: 30	SEM観察基礎編 ～反射電子を使いこなす～	日本電子株式会社 ソリューション開発センター ソリューション推進部 八幡 英里香
13: 30～14: 00	これから始める Volume EM ～電子顕微鏡を用いた 3次元構造解析の紹介～	日本電子株式会社 ソリューション開発センター ソリューション企画室 鈴木 克之
14: 00～14: 35	SEMベース vEMのための実践的試料作製法	久留米大学 太田 啓介 様
14: 35～15: 05	休憩 /実機・ポスター展示	
15: 05～15: 35	～SEMの測定作業を効率化～ 進化した自動観察・分析機能 Neo Action のご紹介	日本電子株式会社 SI事業部門 EP事業ユニット EPアプリケーション部 高山 隼
15: 35～16: 10	SEMによる自動破面解析技術の開発	株式会社豊田自動織機 宮本 大也 様
16: 10～16: 20	閉会挨拶	
16: 20～17: 30	懇親会 /実機・ポスター展示	

*プログラムは予告無く変更させていただく場合がございます。予めご了承くださいませようようお願い申し上げます。